\Box JAPAN PATENT **OFFICE**

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed

with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年10月 3 日 REC'D 23 DEC 2004 WIPO

PCT

号 出 願 Application Number:

特願2003-346117

[ST. 10/C]:

[JP2003-346117]

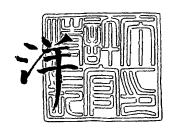
出 人 Applicant(s):

独立行政法人物質・材料研究機構

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN **COMPLIANCE WITH** RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年12月



 【書類名】
 特許願

 【整理番号】
 03-MS-130

 【提出日】
 平成15年10月3日

 【まった】
 株計売馬京 駅

【あて先】 特許庁長官 殿 【国際特許分類】 B82B 1/00 B82B 3/00

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市千現一丁目2番1号 独立行政法人物質・材料研

究機構内

【氏名】 宮澤 薫一

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市千現一丁目2番1号 独立行政法人物質・材料研

究機構内

【氏名】 森 利之

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市千現一丁目2番1号 独立行政法人物質・材料研

究機構内

【氏名】 西村 睦

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市千現一丁目2番1号 独立行政法人物質・材料研

究機構内

【氏名】 須賀 唯知

【特許出願人】

【識別番号】 301023238

【氏名又は名称】 独立行政法人物質・材料研究機構

【代表者】 岸 輝雄

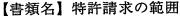
【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

 【物件名】
 明細書 1

 【物件名】
 図面 1

 【物件名】
 要約書 1



【請求項1】

フラーレンのウィスカーまたはファイバーを 5 0 0 ~ 1 0 0 0 ℃の温度範囲で熱処理することを特徴とするフラーレンシェルチューブの製造方法。

【請求項2】

フラーレンが C_{60} フラーレン、 C_{70} 以上の高次フラーレン、金属内包フラーレン、またはフラーレン誘導体であることを特徴とする請求項1のフラーレンシェルチューブの製造方法。

【請求項3】

直径が10 n m ~ 1 0 0 μ m の範囲で長さが1 0 0 n m以上であることを特徴とするフラーレンシェルチューブ。

【請求項4】

チューブ壁が結晶質炭素または非結晶質炭素であることを特徴とする請求項3のフラー レンシェルチューブ。

【請求項5】

チューブの端部が閉鎖または開口していることを特徴とする請求項3または4のフラーレンシェルチューブ。

【請求項6】

内部が中空であるか、または内部が充填されていることを特徴とする請求項3ないし5 のいずれかのフラーレンシェルチューブ。



【書類名】明細書

【発明の名称】フラーレンシェルチュープとその製造方法

【技術分野】

[0001]

この出願の発明は、エネルギー、化学工業、電子・半導体等の各種産業における電界放射デバイス、ガスフィルター、水素吸蔵体、触媒担体など幅広い用途に使用可能なフラーレンシェルチューブとその製造方法に関するものである。

【背景技術】

[0002]

フラーレンの存在は1985年に外国の研究者によって実験的に証明されたが、その構造モデルは、すでに、1970年に日本において知られていた。このように、これまでフラーレンの研究では日本は常に世界をリードしてきた。代表的なフラーレンとしては C_{60} が知られているが、 C_{60} 以外にも C_{70} 、 C_{76} 、 C_{78} 、 C_{82} 、 C_{84} 、 C_{240} 、 C_{540} 、 C_{720} 等の種々のフラーレンが知られている。このフラーレンの分野における技術の進歩は極めて速く、新しいフラーレン系の化合物が次々と紹介されている。最近では、代表的なフラーレンである C_{60} 結晶を真空熱処理することによってフラーレンの非晶質炭素からなる殻(シェル)構造を生成する方法(非特許文献 1)や、液-液界面析出法によってフラーレンウィスカー(炭素細線)を作製する方法等もこの出願の発明者らによって提案されている(たとえば、特許文献 1 および非特許文献 2 、3)。

[0003]

一方、炭素の壁構造を持つチューブとしては、カーボンナノチューブが知られている。このカーボンナノチューブはグラファイトシートを円筒状に丸めた構造のものである。このようなカーボンナノチューブの構造とは相違して、フラーレン針状結晶等の対称性が空間群によって規定される3次元的な周期構造を有するフラーレンウィスカー(FW)やフラーレンナノウィスカー(FNW)から生成されるフラーレンシェルチューブの構造が想定される。しかしながら、これまで、フラーレンの結晶を熱処理することによってフラーレンシェルが生成されることは知られているが、チューブ状のフラーレンシェル(以後、フラーレンシェルチューブと称す)やこのものを得るための方法はこれまで全く知られていない。

【特許文献1】特開2003-1600号

【非特許文献 1】 H. Sakuma, M. Tachibana, H. Sugiura, K. Kojima, S. Ito, T. Sekiguchi, Y. Achiba, J. Mater. Res., 12(1997)1545.

【非特許文献 2】 K. Miyazawa, Y. Kuwasaki, A. Obayashi and M. Kuwabara, " C 60 na nowhiskers formed by the liquid-liquid interfacial precipitation method", J. Mater. Res., 17[1](2002)83.

【非特許文献 3】 Kun´ichi Miyazawa "C70 Nanowhiskers Fabricated by Forming Liquid /Liquid Interfaces in the Systems of Toluene Solution of C70 and Isop ropyl Alcohol", J.Am. Ceram. Soc., 85[5](2002)1297.

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0004]

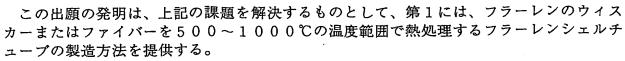
フラーレンシェルチューブは構造的に見ても水素吸蔵体、触媒担体、新規半導体、電界放射材料、燃料電池電極材料などの用途に使用できるものとして期待されるが、前記のとおり、フラーレンシェルチューブを製造するための方法やこのフラーレンシェルチューブ構造についての様々な可能性については知られていないのが実情である。

[0005]

そこで、この出願の発明は新しい機能性材料として期待されるフラーレンシェルチュープとその製造方法を提供することを課題としている。

【課題を解決するための手段】

[0006]



[0007]

第2には、フラーレンが C_{60} フラーレン、 C_{70} 以上の高次フラーレン、金属内包フラーレン、またはフラーレン誘導体である上記のフラーレンシェルチューブの製造方法を提供する。

[0008]

また、この出願の発明は、第3には、直径が $10nm\sim100\mu$ mで長さが100nm以上であるフラーレンシェルチューブを提供する。

[0009]

第4には、チューブ壁が結晶質炭素または非結晶質炭素である上記のフラーレンシェル チューブを提供する。

[0010]

第5には、チューブの端部が閉鎖または開口している上記のフラーレンシェルチューブ を提供する。

[0011]

第6には、内部が中空であるか、または内部が充填されている上記のフラーレンシェル チューブを提供する。

【発明の効果】

[0012]

この出願の第1の発明のフラーレンシェルチューブの製造方法によれば、エネルギー、 触媒、半導体産業における電界放射デバイス、ガスフィルター、水素吸蔵体、触媒担体な ど広範囲な用途での機能性材料として有用なフラーレンシェルチューブを得ることができ る。

[0013]

第2の発明のフラーレンシェルチューブの製造方法によれば、上記と同様な効果が得られ、さらに好適に使用できるフラーレンが選定できる。

[0014]

第3の発明によれば、特有の大きさのフラーレンシェルチューブが提供される。

[0015]

第4の発明によれば、上記と同様な効果が得られ、さらにフラーレンシェルチューブを 構成する炭素の壁の形態が特定化されることになる。

$[0\ 0\ 1\ 6\]$

第5の発明によれば、上記と同様な効果が得られ、さらにフラーレンシェルチューブ壁 の端部の構造が特定化されることになる。

[0017]

第6の発明によれば、フラーレンシェルチューブ内部の態様が特定化されることになる

【発明を実施するための最良の形態】

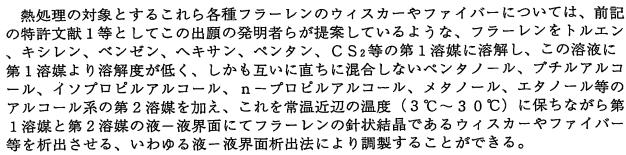
[0018]

この出願の発明は上記のとおりの特徴をもつものであるが、以下にその実施の形態について説明する。

[0019]

この出願の発明では、各種のフラーレンのウィスカーやファイバーを500~1000 ℃の温度範囲で熱処理することによりフラーレンシェルチューブを製造するが、この場合 のフラーレンとは、代表的なC60のウィスカーやファイバーだけでなく、C70以上の高次 フラーレン、金属内包フラーレンさらにはこれまでに知られているもの等の各種のフラー レン誘導体のウィスカーやファイバーを含むものである。

[0020]



[0021]

500 $\mathbb{C}\sim 1000$ \mathbb{C} の温度での加熱は、真空中またはガス雰囲気下において行うが、この場合の真空度は 1 P a 以下の圧力とし、また、ガス雰囲気下としては 1 0^{-1} P a 以下の酸素分圧とすること等が考慮される。アルゴン等の不活性ガスが存在してもよい。

[0022]

そこで以下に実施例を示し、さらに詳しく説明する。もちろん、以下の例によって発明 が限定されることはない。

【実施例1】

[0023]

液-液界面析出法に従って、まず、より純度99.5%のフラーレン(C_{60})を飽和させたトルエン30m1にイソプロピルアルコール30m1を静かに添加する。この溶液を室温(15 \mathbb{C} ~21 \mathbb{C})で約50 時間保持してフラーレンナノウィスカーを作製する。次いで、作製されたフラーレンナノウィスカーを真空中で600 \mathbb{C} に保持して30 分間程度熱処理すると非晶質炭素の壁を持つフラーレンシェルチューブが作製される。

[0024]

図1は作製されたフラーレンシェルチューブの透過電子顕微鏡(TEM)の写真である。写真に示されているようにフラーレンナノウィスカーから作製したフラーレンシェルチュープはナノメートルオーダーの直径を持ち、かつ、矢印で示されているように、元々のフラーレンナノウィスカーの晶癖面を反映して多角形の壁構造を持つものが存在することが確認される。なお、ここでいう晶癖とは結晶の大きさと形状の特徴のことである。

[0025]

図2はフラーレンナノウィスカーを700℃で、30分間、真空中で加熱することによって作製したフラーレンシェルチューブ壁の透過電子顕微鏡(TEM)の写真である。透過電子顕微鏡写真からフラーレンシェルチューブ壁の厚みは約30nmの非晶質炭素であることが確認される。

[0026]

また、図3はフラーレンシェルチューブ壁の透過電子顕微鏡(TEM)の写真である。フラーレンシェルチューブは図3に示されているように端は閉じている場合があることも観察される。また、フラーレンシェルチューブの内部が図4に示されているように充填組織を持つものも観察される。シェルチューブ構造ができる途中として非晶質炭素が充填された状態であると推察される。

[0027]

もちろん、この出願の発明は以上の実施形態および実施例に限定されるものではなく、 詳細については様々な態様が可能である。

【産業上の利用可能性】

[0028]

この出願の発明で得られるフラーレンシェルチューブは、新しい機能性材料として、エネルギー、化学工業、電子・半導体等の各種産業における電界放射デバイス、ガスフィルター、水素吸蔵体、触媒担体など幅広い用途に有用となる。

【図面の簡単な説明】

[0029]

【図1】フラーレンナノウィスカーを600℃で、30分間、真空中で加熱すること 出証特2004-3112345



によって作製したフラーレンシェルチューブの透過電子顕微鏡(TEM)写真である

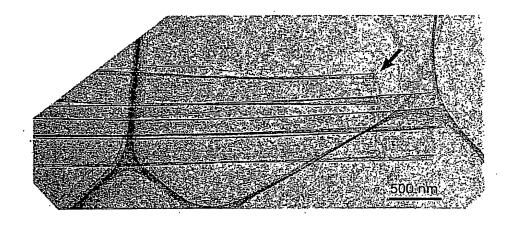
【図2】フラーレンナノウィスカーを700℃で、30分間、真空中で加熱することによって作製したフラーレンシェルチューブの透過電子顕微鏡(TEM)写真である

【図3】フラーレンナノウィスカーを600℃で、30分間、真空中で加熱することによって作製したフラーレンシェルチューブの透過電子顕微鏡(TEM)写真である

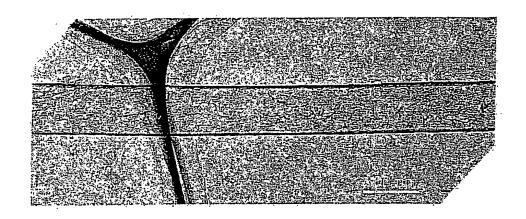
【図4】フラーレンナノウィスカーを600℃で、30分間、真空中で加熱することによって作製した内部に充填組織を持つフラーレンシェルチューブの透過電子顕微鏡(TEM)写真である。



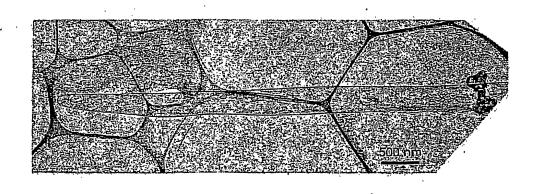
【書類名】図面 【図1】



【図2】

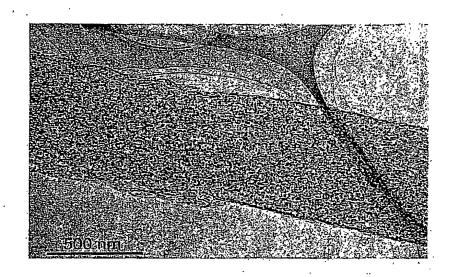


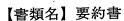
【図3】





【図4】





【要約】

【目的】 エネルギー、触媒、半導体産業における電界放射デバイス、ガスフィルター水素吸蔵体、触媒担体など幅広い用途に使用可能なフラーレンシェルチューブを提供する。

【構成】 液-液界面析出法によって得られたフラーレンのウィスカーまたはファイバーを真空中またはガス雰囲気中で500~1000℃の温度範囲で熱処理する。

【選択図】図1



出願人履歴情報

識別番号

[301023238]

1. 変更年月日

2001年 4月 2日

[変更理由]

新規登録

发更连田」 住 所

氏 名

茨城県つくば市千現一丁目2番1号 独立行政法人物質・材料研究機構